



電気学会 センサ・マイクロマシン部門大会 第34回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

会期:2017(平成29)年10月31日(火)~11月2日(木)

会場:広島国際会議場(広島県広島市)

ホームページ <http://www.sensorsymposium.org/>

本シンポジウムはセンサ・マイクロマシン技術のさらなる発展を目標に、学・協会を超えた研究グループ間の情報交換、研究成果およびアイデアの討議の場として開催される、当該分野における日本最大のシンポジウムです。会期中は日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門主催の「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」、応用物理学会集積化MEMS技術研究会主催の「集積化MEMSシンポジウム」が同時開催されます。またエレクトロニクス実装学会および電子情報通信学会との連携セッションも開催されます。本シンポジウムに参加登録すると、これらの同時開催シンポジウム・セッションにも参加することができます。今回新たな試みとして、**一般投稿を基本的にポスター発表のみ**とすることで、これまで以上に密な議論の場を提供することにしました。また、魅力的な基調講演に加え、テクニカルツアー、技術ポスター発表、研究者交流企画なども予定しております。皆様からの積極的な投稿とご参加をお待ちしております。

○ 論文募集分野 (詳細はホームページに掲載)

1. 設計・製作技術, 材料
2. マイクロナノシステム
3. センサ・アクチュエータシステム
4. フィジカルセンサ
5. ケミカルセンサ
6. バイオセンサ
7. バイオマイクロナノシステム
8. 企画セッション (エレクトロニクス実装学会連携)

この1年に国際会議で発表された研究成果を日本国内に情報発信する機会としてご活用いただくことも歓迎いたします。また、電気学会の研究会および総合研究会の発表論文に新規データ(未公開データを含む)を追加した上で投稿可能です。

○ 発表形式および使用言語

発表形式: ポスター形式

(今回は新しい試みとして一般投稿についてはポスター発表のみとします。五十嵐賞, 奨励賞, 最優秀技術論文賞, 優秀技術論文賞候補者のみ口頭発表も行います。)

使用言語: 日本語または英語

○ 発表申込方法

発表概要(A4版2ページ, PDFフォーマット)を、ホームページから投稿してください。投稿された発表概要は論文委員会で審査し、採否を通知します。

発表申込締切	2017(平成29)年5月29日(月)正午
延長申込締切	2017(平成29)年6月12日(月)正午
採否結果通知	2017(平成29)年7月21日(金)
講演論文締切	2017(平成29)年8月18日(金)
口頭発表通知	2017(平成29)年9月15日(金)予定

○ 速報発表申込方法

ポスター発表のみ、速報発表申込も受け付けます。投稿された論文は論文委員会で審査され、採否を通知します。

速報申込締切 2017(平成29)年9月8日(金)

○ 表彰

発表概要, 講演論文および会期中の発表を審査し、五十嵐賞, 奨励賞, 最優秀技術論文賞, 優秀技術論文賞, 優秀ポスター賞の各賞を選定し、シンポジウム会場で表彰を行います。各賞の選考対象となるためには、**発表申込時点で電気学会の会員であること(申請中を含む)**が必要です。あらかじめ、**会員資格をご確認ください。**

○ 学生会員無料入会キャンペーン

発表申込みもしくは参加申込と同時に電気学会に入会すると、初年度学生会員費が無料になります。

○ 参加申込

早期割引は10月13日(金)までです。

○ テクニカルツアー

シンポジウム前日10月30日(月)午後、マツダ(株)の工場見学を開催します。奮ってご参加ください。(無料, 定員制)

○ 研究者交流企画

ポスター会場を利用して、本シンポジウムに関連する研究者・研究グループを紹介するポスター展示を行います。

○ 技術ポスター発表

センサ, MEMS デバイス関係およびその応用システム製品, 設計ツール, 製造装置, 測定機器, 材料, 実装技術関係, 書籍などのポスター発表が可能です。技術プレゼンテーションセッションもあります。

技術ポスター発表申込締切 2017(平成29)年9月29日(金)

○ 同時開催シンポジウム

■■■ 第8回「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」 ■■■

ホームページ <http://www.jsme.or.jp/mnm/>

■■■ 第9回「集積化MEMSシンポジウム」 ■■■

ホームページ <http://annex.jsap.or.jp/MEMS/>

主催 電気学会 センサ・マイクロマシン部門

協力 応用物理学会 集積化MEMS技術研究会

日本機械学会マイクロ・ナノ工学部門

協賛 (依頼中含む)エレクトロニクス実装学会, 応用物理学会, 化学とマイクロ・ナノシステム学会, 計測自動制御学会, システム制御情報学会, 次世代センサ協議会, 精密工学会, センシング技術応用研究会, 電気化学会, 電子情報通信学会, 日本材料学会, 日本真空学会, 日本信頼性学会, 日本生体医工学会, 日本赤外線学会, 日本ロボット学会, ニューセラミックス懇話会, マイクロマシンセンター, レーザー学会, 電気学会関連技術委員会

○ 問合せ先

「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム事務局

株式会社セミコンダクタポータル

電話: 03-5733-4971, FAX: 03-5733-4973

E-mail: sensorsympo_2017@semiconportal.com